

レーザー干渉計システム



レーザー干渉計システム

Zygo.co

GPI-XP

平成8年度導入

【主な用途・仕様】

レーザー光により基準平面と測定物の間に干渉縞を発生させ、その干渉縞の変位から光学部品や精密加工部品の平面度を迅速に測定する。等高線図、断面形状を求めることも可能である。

- ・光源 He-Ne, $\lambda = 632.8\text{nm}$
- ・分解能 $\lambda / 12,000$
- ・測定口径 102mm

【担当部署】 精密機械金属技術部：機械グループ

【設備使用の項目・使用料】 レーザー干渉計システム

【受託試験の項目・手数料】 精密測定試験（中級）